

В катодной линзе предмет является катодом (источником электронов) и одновременно электродом оптической системы. Её называют иммерсионным объективом, т. к. показатели преломления по обе стороны линзы различные. В объективе происходит ускорение электронов, испущенных термо-, фото-, автокатодом или катодом второй эмиссии, и формирование его изображения. Иммерсионный объектив, состоящий из катода и анода, не может фокусировать электронные пучки, поэтому вводят дополнительный фокусирующий электрод (рис. 7) или применяют магнитную фокусирующую линзу.

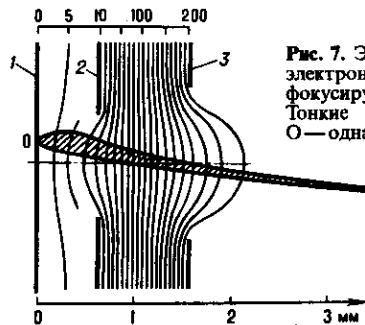


Рис. 7. Электроэлектростатическая катодная электронная линза: 1 — катод; 2 — фокусирующий электрод; 3 — анод. Тонкими линиями — эквипотенциалы; О — одна из точек катода. Заштрихованное пространство — сечение области, занятой потоком электронов, испущенных из точки О.

Другие типы Э. л. Магн. и электростатич. цилиндрич. Э. л. фокусируют пучки заряж. частиц в одной плоскости и по своему действию подобны цилиндрич. линзам световой оптики. Электроэлектростатич. цилиндрич. Э. л. состоят из щелевых диафрагм или продольных пластин — электродов, расположенных симметрично относительно средней

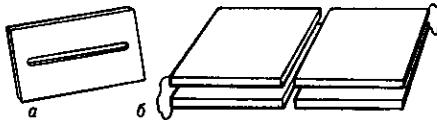


Рис. 8. Электроэлектростатические цилиндрические электронные линзы: а — диафрагма со щелью; б — иммерсионная линза, состоящая из двух пластин. В области прохождения заряженных частиц поле линзы не изменяется в направлении, параллельном щелям диафрагм или зазорам между пластинами соседних электродов.

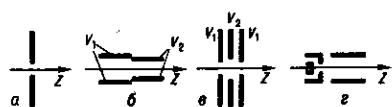


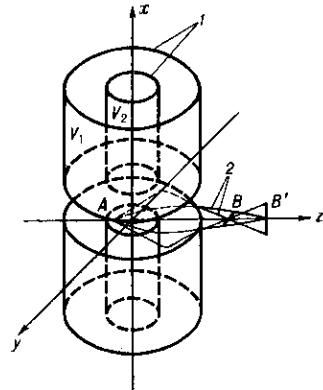
Рис. 9. Сечение электродов электроэлектростатических цилиндрических линз плоскостью, проходящей через ось z перпендикулярно средней плоскости: а — цилиндрическая (щелевая) диафрагма; б — иммерсионная цилиндрическая линза; в — одиночная цилиндрическая линза; г — катодная цилиндрическая линза;  $V_1$  и  $V_2$  — потенциалы соответствующих электродов.

плоскости (рис. 8 и 9), и действуют (по аналогии с осесимметричной оптикой) как одиночные диафрагмы или иммерсионные, катодные и одиночные линзы.

Поля трансаксиальных электростатич. линз обладают симметрией вращения относительно оси (ось x на рис. 10), края перпендикулярна оптической оси. Пучок, выходящий из точки A предмета, после фокусировки полем линзы становится астигматическим и образует два линейных изображения B и B'. Однако при надлежащем подборе параметров Э. л. изображение может стать стигматическим.

Квадрупольные магн. и электростатич. линзы имеют поля с двумя взаимно перпендикулярными плоскостями симметрии. Векторы напряженности полей в области распространения электронного пучка почти перпендикулярны

Рис. 10. Электроэлектростатическая трансаксиальная электронная линза с электродами в виде двух соосных цилиндров с кольцевыми щелями для прохождения пучка электронов; 1 — цилиндрические электроды; 2 — траектории электронов;  $V_1$  и  $V_2$  — потенциалы электродов.



скоростям электронов (рис. 11). Благодаря этому фокусирующее действие на пучки электронов многократно возрастает по сравнению с осесимметричным полем. Одна квадрупольная Э. л. не создает стигматич. изображения, она действует в одной меридиональной плоскости как собирающая, а в другой, в перпендикулярной, как рассеивающая линза. Два последовательно расположенных и надлежащим образом ориентированных по азимуту ква-

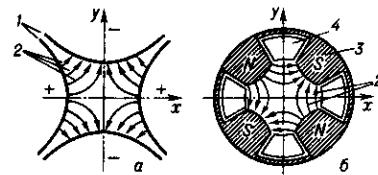


Рис. 11. Сечения квадрупольных электронных линз: а) — электростатической, б) — магнитной. а) показывает перпендикулярные направления движения пучка электронов: 1 — электроды, 2 — силовые линии полей; б) показывает магнитный полюс 3 и обмотку возбуждения 4.

дрополя (дублет, рис. 12) создают стигматич. изображение, но с дисторсией, т. к. увеличения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях разные. Стигматич. изображение без дисторсии получается с помощью двух дубле-

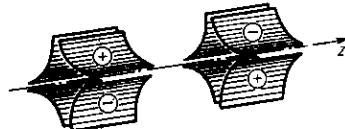


Рис. 12. Дублет из двух квадрупольных электронных линз, поля которых повернуты вокруг оптической оси z системы относительно другого на угол 90°.

тов. Благодаря большой оптич. силе квадрупольные системы способны фокусировать пучки заряж. частиц с большими энергиями, а в случае магн. линз — и с большими массами, чем осесимметрические системы.

*Лит.*: Косслет В., Введение в электронную оптику, пер. с англ., М., 1950; Явор С. Я., Фокусировка заряженных частиц квадрупольными линзами, М., 1968; Ардимович Л. А., Лукьянов С. Ю., Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях, М., 1972; Grivet P. [a. o.], Electron Optics, 2 ed., pt 1—2, Oxf., 1972; Баранова Л. А., Явор С. Я., Электроэлектростатические электронные линзы, М., 1986; см. также лит. при ст. Электронная и ионная оптика.

П. А. Стоянов.

**ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИЗМЫ** — электронно-оптические (существенно, ионные призмы — ионно-оптические) системы, предназначенные для отклонения пучков заряж. частиц или для разделения таких частиц по энергиям и массам. Э. п. получили своё название в рамках общей аналогии